

SuperView WX100

Sonde d'interface à lumière blanche

Inspection en ligne de la rugosité et du profil 3D



Double protection anti-collision
Logiciel ZSTOP et capteurs électroniques matériels. Le système peut également accepter des signaux électroniques externes d'anti-collision.

Course de déplacement Z : 30 mm
Capable de mesurer des échantillons de différentes hauteurs. Les utilisateurs n'ont pas besoin de préparer un axe Z motorisé

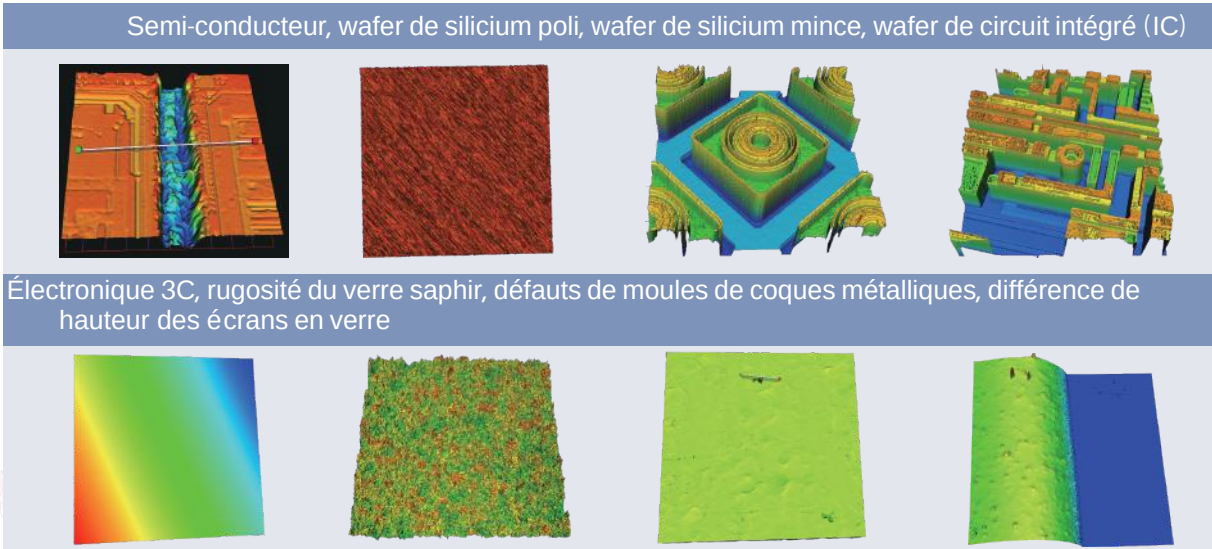
Système d'inclinaison motorisée à 4 degrés de liberté (DOF)
Conception d'ajustement d'inclinaison électrique offrant quatre degrés de liberté en tangage et en lacet, ce qui réduit fortement la complexité de fabrication de la platine de mesure du client.

SDK
Fourniture d'un package logiciel permettant aux clients de réaliser des développements secondaires, afin de développer leurs propres programmes pour piloter la sonde et effectuer des mesures et analyses automatiques.

Functions

- Fonction de mesure : permet de réaliser un balayage Z haute précision de la surface de l'échantillon et d'obtenir une image 3D..
- Fonction d'analyse : permet d'obtenir des données 2D et 3D telles que la rugosité de surface, des dimensions de contour à l'échelle micro et nano, etc.
- Fonction de programmation : prise en charge de processus de traitement et d'analyse de données préconfigurés, permettant de réaliser en un clic l'ensemble du flux, de la mesure à l'analyse.
- Analyse par lots : les modèles de traitement et d'analyse de données peuvent être personnalisés selon les besoins du client, permettant une analyse par lots en un clic pour des données de paramètres de même type.

Application



Parameters

Référence		SuperView WX100
Source lumineuse		LED blanche
Système vidéo		1024×1024
Objectif		10X(2.5X, 5X, 20X, 50X, 100X optional)
F.O.V.		0.98×0.98mm(10X)
Tourelle d'objectifs		Trou unique / 3 Perçage manuels
Dimensions		230×200×380mm
Inclinaison		±2° Motorisé
Course de déplacement Z		30mm
Plage de balayage Z		10mm (Dépend de l'objectif)
Résolution Z		0.1nm
Répétabilité de la rugosité RMS*1		0.01nm
Mesure de marche (hauteur de marche)	Précision*2	0.5%
	Répétabilité*2	0.1% 1σ

Note:
*1 Mesure de Sa 0,2 nm sur wafer de silicium en environnement de laboratoire conformément à la norme ISO 25178.
*2 Mesure d'un bloc étalon de hauteur de marche de 5 µm en environnement de laboratoire conformément à la norme ISO 10610-1:2009.